

超解像顕微鏡テクニカルセミナー & ImageJ活用術

日時 : 2017年6月20日(火) 13:00~14:55

会場 : 東京工業大学 すすかけ台キャンパス
B2棟 4F 大会議室

■ 13:00~13:55 超解像テクニカルセミナー

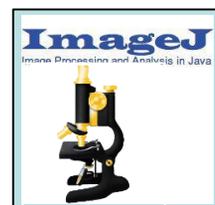
2014年のノーベル化学賞を受賞した超解像顕微鏡技術 STED (Stimulated emission depletion) の原理と使用例について紹介します。

(6月26-30(月-金)に、S2棟5F West 509室で実機のデモがあります)



■ 14:00~14:55 ImageJ活用術

NIHで開発されたImageJは、非常に便利な画像解析アプリケーションです。細胞数のカウントや蛍光強度の計測など、様々な画像解析を比較的簡単に行うことができます。



ImageJを用いた解析に必要な画像の取得方法から、解析の手順、解析事例などを解りやすく説明します。

問い合わせ先

ライカマイクロシステムズ(株)
石坂 信也
03-6758-5640
E-mail: shinya.ishizaka@leica-microsystems.co.jp



学内窓口

東京工業大学 科学技術創成研究院
木村 宏
(内線5742)
E-mail: hkimura@bio.titech.ac.jp

顕微鏡画像解析相談会

—どんな顕微鏡画像でもご相談ください—

日時 : 2017年6月21日(水)

会場 : 東京工業大学 すすかけ台キャンパス
S2棟 5F West 509室

※20日セミナー後に参加予約表をご用意します。

セミナー参加が難しい場合は事前にLeica担当者へご連絡ください

- ・自分が持つ画像で解析方法を知りたい、
 - ・どんな解析ソフトを選べばいいか教えてほしい、
- そんなお悩みにお答えしていきます。

どのメーカーの画像でもご相談にのります



問い合わせ先

ライカマイクロシステムズ(株)
鶴巻 宣秀
03-6758-5640
E-mail: shinya.ishizaka@leica-microsystems.co.jp

Leica
MICROSYSTEMS

学内窓口

東京工業大学 科学技術創成研究院
木村 宏
(内線5742)
E-mail: hkimura@bio.titech.ac.jp